

2020/5/29

共通機器センター装置担当者各位

SIT 総研事務局
Office of SIT Research Laboratories

豊洲テクノプラザ、大宮先端研の共通機器センターの運営は、以下のリストの通り、多くの装置担当者の皆様の協力により成り立っています。この場をお借りして、深く感謝いたします。

The office of SRL would like to acknowledge and thank the faculty and technical staff members in charge for managing and maintaining the shared equipment and facilities at Shared Equipment Centers at Toyosu and Omiya Campuses.

装置担当者リスト List of the faculty and technical staff members in charge of equipment

2020年3月30日現在

豊洲共通機器センター Shared Equipment Center in Toyosu campus

装置名, Equipment	所属学科/装置担当者(敬称略), Dept./Person in charge				
XRD—Ultima IV	B 高崎明人	T 関宏範			
XRD—SmartLab	C 石崎貴裕	T 関宏範			
XRD—Rint ttr3	C 正木匡彦	D 清野肇	T 関宏範		
卓上 SEM (FEI)	T 関宏範	E 西川宏之			
分析 SEM (Shimadzu)	E 西川宏之	T 関宏範			
JSM-6010LV (JEOL)	T 関宏範	A 山田純			
JSM-7610 (JEOL)	C 石崎貴裕	G 上野和良	C 芹澤愛	C 村上雅人、 岡徹雄	T 関宏範
JSM-7100 (JEOL)	C 荻谷義治	E 西川宏之	T 関宏範		
試料コータ (JEOL)	C 石崎貴裕	T 関宏範			
EPMA(Shimadzu)	C 石崎貴裕	C 芹澤愛	C 村上雅人、 岡徹雄		T 関宏範
TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)	T 関宏範	C 村上雅人			
レーザー顕微鏡 1 (Olympus)	T 関宏範	E 長谷川忠大			
レーザー顕微鏡 2 (Olympus)	T 関宏範	A 山田純			
デジタルマイクロスコープ	T 関宏範	A 山田純			
光顕 BX51(Olympus)	T 関宏範	A 山田純			
光顕 DM LM(Leica)	T 関宏範	C 村上雅人			
汎用 AFM	C 石崎貴裕	E 西川宏之	C 松村一成	T 関宏範	
高機能 AFM	C 石崎貴裕				
引張圧縮試験機	T 関宏範	C 村上雅人	B 青木孝史朗		
顕微ラマン分光装置	G 上野和良	C 石崎貴裕	T 関宏範		
ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム	D 吉見靖男	T 関宏範			
FT-IR 分光光度計	C 石崎貴裕	E 西川宏之	T 関宏範		
紫外可視分光光度計	E 松本聡	E 西川宏之	T 関宏範		
テラヘルツ分光光度計	E 松本聡	E 西川宏之	T 関宏範		
広範囲波長分光光度計	D 田嶋稔樹	A 山田純	E 西川宏之	T 関宏範	
X線 CT スキャナ	L 井尻敬	T 関宏範			
スパッタリング装置	B 長澤純人	T 関宏範			
サーマルマネキン	J 秋元孝之	T 関宏範			

自動接触角測定装置	T 関宏範	D 吉見靖男			
窒素吸着比表面積細孔分布測定装置	T 関宏範	D 野村幹弘			
窒素水蒸気吸着比表面積細孔分布測定装置	T 関宏範	D 野村幹弘	D 堀顕子		
マスクレス露光装置	G 石川博康	T 関宏範			
ゼーマン原子吸光光度計	T 関宏範	D 今林慎一郎			
質量分析計	T 関宏範	D 濱崎啓太			
円 2 色性分散計	T 関宏範	D 濱崎啓太			
核磁気共鳴装置 (NMR)	D 田嶋稔樹	E 西川宏之	T 関宏範		
レーザー加工機	J 青島啓太	T 関宏範			
テクノ工房	E 安孫子聡子	E 長谷川忠大			
モーションキャプチャー	E 長谷川忠大	E 安孫子聡子			
抵抗加熱蒸着装置	E 西川宏之	B 長澤純人	T 関宏範		
電子ビーム蒸着装置	E 西川宏之	B 長澤純人	T 関宏範		
D-RIE 装置	B 長澤純人	E 西川宏之	T 関宏範		
2 次元印刷装置	B 長澤純人	E 西川宏之	T 関宏範		
その他 MEMS 装置機器群	B 長澤純人	E 西川宏之	T 関宏範		
手動回転研磨機	T 関宏範				
イオン化飛行時間型質量分析計 (Shimadzu)	D 木戸脇匡俊	T 関宏範			

2020年3月11日現在

大宮共通機器センター Shared Equipment Center in Omiya campus

装置名, Equipment	学科/装置担当者 (敬称略) Dept./Person in charge				
FE-SEM (JSM-7400)	E 西川宏之	D 清野肇	T 金子守		
TEM (JEM-2100)	C 下条雅幸	C 石崎貴裕	SRL 張暁賓	T 金子守	
FIB (FB-2000A)	C 松村一成	E 西川宏之	T 金子守		
XRD (Smart Lab)	理工山本文子	B 青木孝史朗	T 金子守		
単結晶 X 線構造解析装置 (D8 Q)	D 堀頭子	T 金子守			
SQUID 装置 (MPMS)	理工山本文子	C 村上雅人	T 金子守		
プロトンビームライター (PBW)	E 西川宏之	T 金子守			
質量分析装置 (LCMS)	N 須原義智	N 福井浩二	N 越阪部奈緒美	N 廣田佳久	
核磁気共鳴装置 (NMR)	D 幡野明彦	N 須原義智			
ピコ秒蛍光寿命測定装置	D 中村朝夫	D 堀頭子	T 金子守		
絶対 PL 量子収率測定装置	D 中村朝夫	D 堀頭子	T 金子守		
D-RIE 装置	B 長澤純人	E 西川宏之	T 金子守		
レーザー顕微鏡	E 西川宏之	T 金子守			
真空蒸着装置	E 西川宏之	T 金子守			
マイクローム	E 西川宏之	T 金子守			
研磨装置	E 西川宏之	T 金子守			
マニュアルプローバー (半導体 パラメーターアナライザー、 C-V 測定器)	E 西川宏之	T 金子守			
金コーティング装置	E 西川宏之	T 金子守			
TEM 試料ホルダー予備排気装置	C 下条雅幸	SRL 張暁賓	T 金子守		
超純水製造装置	E 西川宏之	T 金子守			
光学顕微鏡	E 西川宏之	T 金子守			
ナノインプリント装置	E 西川宏之	T 金子守			
超臨界乾燥装置 (SCRD4)	E 西川宏之	T 金子守			
熱処理装置 (電気炉)	E 西川宏之	T 金子守			
無電解メッキ装置	E 西川宏之	T 金子守			
スピコーター	E 西川宏之	T 金子守			
膜厚計測装置	E 西川宏之	T 金子守			
超音波ホジナイザー	E 西川宏之	T 金子守			